Si ドープとSi イオン注入単結晶酸化ガリウム結晶の光学的特性

Optical Properties of Si-doped and Si-implanted β-Ga₂O₃ single crystals 工学院大¹, 情通機構², タムラ製作所³, ⁰尾沼 猛儀^{1,2}, 佐々木 公平^{3,2}, 増井 建和³, 山口 智広¹, 本田 徹¹, 倉又 朗人³, 東脇 正高² Kogakuin Univ.¹, NICT², Tamura Corp.³, ^oT. Onuma^{1,2}, K. Sasaki^{3,2}, T. Masui³, T. Yamaguchi¹, T. Honda¹, A. Kuramata³, and M. Higashiwaki²

E-mail: onuma@cc.kogakuin.ac.jp

[はじめに] β-Ga₂O₃はバンドギャップ(*E_g*)が GaN や SiC よりも大きく、単結晶作製も比較的 容易なため、高耐圧、低損失のパワーデバイスを低コスト・低エネルギーで製造できる材料とし て注目される。本研究では Si ドープがバンド構造や発光特性に及ぼす影響に注目しているが、バ ンド構造に関しては、これまで上田他による Burstein-Moss シフトの報告[1]と、それに続く山口に

よる第一原理計算の報告[2]があるのみで未解明な点 が多い。また発光特性に関しては、青色発光強度と抵 抗率の相関を見出し、酸素空孔(*Vo*)が青色発光に関 与することを明らかにしてきた[3]。このような背景か ら、本講演では、SiドープとSiイオン注入された単 結晶基板の光学的特性を比較した結果を報告する。

[実験] EFG 法により成長した(201)面 Si ドープ基板 [4]の有効ドナー濃度(N_d - N_a)は 3×10^{17} - 7×10^{18} cm⁻³であ る。また、FZ 法により成長した(010)面の無添加基板 へ Si⁺を注入した[5]。ポストアニール後、Si⁺濃度が 5×10^{19} と 1×10^{20} cm⁻³ の 基板に対しそれぞれ N_d - N_a = 3×10^{19} と 4×10^{18} cm⁻³が得られた。

[結果と考察] 図 1 と図 2 にカソードルミネセンス (CL) スペクトルを示す。バンド端発光は観測され ず、3.2~3.6 eV に紫外線発光帯 (UVL) が観測された。 これまでの報告[3]と同様に、Si ドープ基板では Voの 形成が抑制されるため 2.8~3.0 eV の青色発光帯は観 測されなかった。図 2 に示すように、Si イオン注入し た基板には 2.4 eV 付近に緑色発光帯 (GL) が観測さ れた。Si⁺濃度が 1×10²⁰ cm⁻³ と過剰に注入された試料 では N_d - N_a =4×10¹⁸ cm⁻³ と活性化率が著しく低下して いる[5]ことから、Ga 空孔が関与した深いアクセプタ 一準位の寄与が示唆される。



Fig. 1 Temperature-dependent CL spectra of (201) Si-doped β -Ga₂O₃ single crystal.



Fig. 2 Temperature-dependent CL spectra of (010) Si-implanted β -Ga₂O₃ single crystal.

[謝辞]本研究の一部は科研費(#25289093、#17H01263)の援助を受けた。

[参考文献] [1] N. Ueda *et al.*, Appl. Phys. Lett. **71**, 933 (1997). [2] K. Yamaguchi, Solid State Commun. **131**, 739 (2004). [3] T. Onuma *et al.*, Appl. Phys. Lett. **103**, 041910 (2013). [4] A. Kuramata *et al.*, Jap. J. Appl. Phys. **55**, 1202A2 (2016). [5] K. Sasaki *et al.*, Appl. Phys. Express **6**, 086502 (2013).